

SEM・表面分析・前処理セミナー@名古屋

プログラム

09: 30～	受付
10: 00～10: 10	開会挨拶
10: 10～10: 40	ネットワークで遠隔操作！ IoT クロスセクションポリッシャ™ IB-19540CP, IB-19550CCPの紹介 日本電子株式会社 EP事業ユニット EPアプリケーション部 長谷部 祐治
10: 40～11: 10	新型 FE-SEM JSM-IT810の紹介 日本電子株式会社 EP事業ユニット EP技術開発部 新美 大伸 名越 達郎
11: 10～11: 40	EDS-MAPのコツ！ ～データの取得方法から解析まで～ 日本電子株式会社 ソリューション開発センター ソリューション推進部 八幡 英里香 E X事業ユニット E X技術開発部 藤井 敦大
11: 40～12: 10	昼食
12: 10～13: 00	実機・ポスター展示
13: 00～13: 30	脂材料の分析困っていませんか？ 日本電子株式会社 SA事業ユニット SA技術開発部 上條 栞
13: 30～14: 00	SXES分析をより便利に、より簡単に ～使いやすくなった新 SXESソフトウェアのご紹介～ 日本電子株式会社 SA事業ユニット SA設計部 木下 真吾
14: 00～14: 30	Arイオンを利用した試料前処理と加工ダメージの検討 ～半導体試料の AES分析に向けて～ 日本電子株式会社 SA事業ユニット SA技術開発部 鍋島 冬樹
14: 30～15: 00	ICPより超簡単！XRFによる液体分析最前線 日本電子株式会社 SA事業ユニット SA技術開発部 村谷 直紀
15: 00～15: 50	休憩 / 実機・ポスター展示
15: 50～16: 20	FIB-SEM JIB-PS500iの紹介 ～TEM試料作製から三次元測定まで～ 日本電子株式会社 EP事業ユニット EPアプリケーション部 中島 雄平
16: 20～16: 50	透過電子顕微鏡とは？～透過電子顕微鏡の原理と応用～ 日本電子株式会社 EM事業ユニット EMアプリケーション部 三浦 颯人
16: 50～17: 00	閉会挨拶
17: 10～18: 10	懇親会 / 実機・ポスター展示

* プログラムは予告無く変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。よろしくお願い申し上げます。